(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-122198

(43)公開日 平成7年(1995)5月12日

(51) Int.Cl.8

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01J 21/06

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 3 頁)

(21)出願番号	特顯平5-266644	(71)出願人	000004237 日本電気株式会社
(22)出顯日	平成5年(1993)10月25日	(72)発明者	東京都港区芝五丁目7番1号 日高 睦夫 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内
		(72)発明者	曾根 純一 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内
		(72)発明者	中村 和夫 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内
	•	(74)代理人	弁理士 京本 直樹 (外2名)

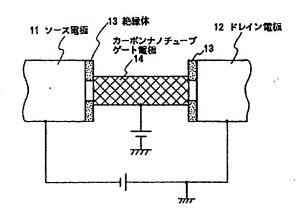
(54) 【発明の名称】 カーポンナノチュープトランジスタ

(57)【要約】

【目的】 極めて小型で、低電圧動作のトランジスタを 提供する。

【様成】 カーボンナノチューブ電極14の両端に絶縁体13を介してソース電極11とドレイン電極12を設ける。ナノチューブは円筒形で中は通常、真空である。従ってソース・ドレイン電極の間に電圧を印加すると、

従ってソース・ドレイン電極の間に電圧を印加すると、 ソース電極からドレイン電極に向かって電子が放出され ドレイン電流となる。ナノチューブ14にゲート電圧を 印加すると、ドレインに到達する電子の数を制御すると とができトランジスタとして動作する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゲート電極となるカーボンナノチューブ の両端に絶縁体を介してそれぞれソース・ドレイン電極 が設けられ、ソース電極とドレイン電極の間に電圧が印 加されてソース電極からドレイン電極に向かって電子が 放出され、カーボンナノチューブに印加されるゲート電 圧によってドレインに到達する電子の数を制御すること を特徴とするカーボンナノチューブトランジスタ。

【請求項2】 ソース電極の電子が放出される部分は絶 縁体が設けられていない請求項1に記載のカーボンナノ 10 チューブトランジスタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子回路等に用いられる トランジスタに関する。

[0002]

【従来の技術】図2は一般的な3極真空管を模式的に示 した図である。3極真空管では陰極21と陽極22間に 電圧を印加し、陰極21から電子を放出させ、陽極22 で受け取る。このときグリッド23に正電圧をかける と、電子はグリッドに補足され陽極22に到達する数が 減少する。このようにグリッド23の電圧をコントロー ルすることによって陰極21-陽極22間の電流を制御 することができ、トランジスタが構成できる。またこの トランジスタは電子の走行経路を真空に保ためガラス管 24の中に封入されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の技術で述べた3 極真空管は、半導体トランジスタと比べると寸法が大き いという欠点があった。このことにより、陰極21から 30 陽極22への電子の走行時間が長い、高い印加電圧が必 要等の不都合が生じ、結果として動作が遅く消費電力が 高くなっていた。また集積化にも不向きであった。

【0004】本発明は、従来の3極真空管の欠点を克服 し、半導体トランジスタを上回る性能を持ったカーボン ナノチューブを用いた超小型で超高性能のトランジスタ を提供することを目的としている。

[0005]

【発明を解決するための手段】本発明は、ゲート電極と ぞれソース・ドレイン電極が設けられ、ソース電極とド レイン電極の間に電圧が印加されてソース電極からドレ イン電極に向かって電子が放出され、カーボンナノチュ ーブに印加されるゲート電圧によってドレインに到達す る電子の数を制御することを特徴とするカーボンナノチ ューブトランジスタである。ソース電極の電子が放出さ れる部分は絶縁体を設けず露出しておき、電子を放出し やすくするとよい。

[0006]

【作用】カーボンナノチューブは「固体物理」第27

巻、第6号、第441頁(1992年)にあるようにナ ノメートルサイズの黒鉛の円筒形の極微細管で、金属ま たは半導体の性質を持つ導電体である。カーボンナノチ ューブ(以下ナノチューブと略称する)の直径は2~5 0 n mと極めて小さい。また円筒壁は炭素の6員環でで きており、酸素や窒素等のガスは透過できない。そのた めナノチューブの内側は製造時に真空であれば、その後 は真空に保たれる。

【0007】とのナノチューブの内側を電子の通り道と して真空管式トランジスタを構成すれば、ナノチューブ に正電圧を印加することで、ナノチューブ円筒壁に電子 を引きつけることができ、電流が変調できる。このナノ チューブ真空管式トランジスタは、ナノチューブのサイ ズを反映して極めて小型であるため、極めて低い電圧の 印加で電流が変調できる。また電子の走行距離も短くで き、超高速で消費電力の極めて小さなトランジスタが実 現できる。

[0008]

【実施例】図1は本発明の実施例を説明するための図で 20 ある。以下図1を用いて本発明の実施例の説明を行う。 【0009】銅からなるソース電極11、同じく銅から なるドレイン電極12とがアルミニウム酸化物からなる 絶縁体13をそれぞれ介してナノチューブ14で接続さ れている。ナノチューブはゲート電極14となる。ソー ス電極11とドレイン電極12間およびナノチューブ1 4からなるゲート電極はそれぞれ独立に電圧が印加され る。ナノチューブゲート電極14とソース電極11およ びドレイン電極12の間は絶縁体13によって完全に絶 縁されている。ナノチューブゲート電極14は直径が3 Onm長さが100nmである。また絶縁体13の厚さ はそれぞれ10 nmである。

【0010】ナノチューブゲート電極14の円筒壁は炭 素の6員環でできており、酸素や窒素等のガスは通過で きない。そのため製造時にナノチューブゲート電極14 内部が真空であるならば、その後も内部はほぼ真空に保 たれる。(ナノチューブは通常、炭素電極を用いた真空 中のアーク放電で製造する。)図1のトランジスタの動 作は以下のように行われる。まずソース電極11とドレ イン電極12間に電圧が印加されると、ソース電極表面 なるカーボンナノチューブの両端に絶縁体を介してそれ 40 から電子が放出され、電解に引かれてドレイン電極12 に達する。このときナノチューブゲート電極14に正電 圧が印加されると、前記ソース電極11から放出された 電子の軌道は曲げられ、一部の電子がナノチューブゲー ト電極14の方に流れる。従って、ナノチューブゲート 電極14に印加する電圧によってソース電極11-ドレ イン電極12間の電流を変調するトランジスタ動作が得 られる。

> 【0011】一般に電解電子放射を得るには10'V/ cm程度の電解強度が必要であるが、ソース電極11と ドレイン電極12間の距離が120nmと極めて短いと

とと、ソース電極11とドレイン電極12の先端は30 nm程度であり著しく劣っており電解強度が高いととか ら、mVオーダーの電圧で動作させることが可能であ る。またゲート電圧とソースドレイン電圧の比は、ナノ チューブゲート電極14の半径とソース電極11とドレ イン電極12間の比(本実施例の場合1:8) に比例す るため、ゲート電圧はソースドレイン電圧よりさらに低 くすることができ、高いゲインが得られる。

【0012】以上説明したように本実施例を用いれば、 得られる。低電圧動作のドランジスタはスイッチ時間が 短く、消費電力が小さくなる。また、ナノチューブの寸 法を反映して、超小型のトランジスタを構成できる。

【0013】ここで、このトランジスタの製造方法を説 明する。まずアーク放電等で絶縁基板上にナノチューブ を堆積させ、真空を破らずに別のチャンバーに移す。次 に真空蒸着法でアルミニウム薄膜を厚さ数nm堆積す る。次にまた別のチャンバに移して酸素プラズマ中で酸 化してアルミニウム酸化物を形成する。さらに別のチャ ンバに移送してから、基板を大きく傾けてアルゴンを用 いた異方性エッチングを行うと、ナノチューブの両端の アルミニウム酸化物が除去されナノチューブの両端を開 口するととがきる。その後銅の薄膜を形成する。これは 銅を構成元素として含むガス(有機金属化合物など)を 基板上に流し、きわめて細く絞った電子ビームをナノチ ューブの両端のソース・ドレイン電極となる部分にだけ 照射してガスを分解するとそとに銅薄膜バターンを堆積× *できる。なお電極パターンを形成するには、電子ビーム の照射以外に、STM (Scanning Tunne ling Microscope)用の微細な針を、電 極を形成すべき部分に位置合わせし、前記のガスを流 し、基板との間に電流を流してガスを分解する方法もあ る。

[0014]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、ナノチュ ーブを用いることで、極めて小型で、低電圧動作が可能 低電圧で動作しかも高いゲインを有するトランジスタが 10 なトランジスタを提供できる。このようなトランジスタ はスイッチング速度が大きく、消費電力が小さい等非常 に優れたトランジスタである。

【図面の簡単な説明】

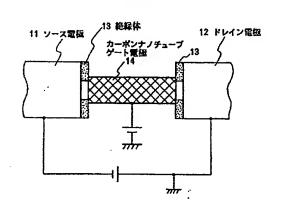
【図1】本発明の実施例を説明するためのカーボンナノ チューブを用いたトランジスタの概略図。

【図2】従来の技術を説明するための3極真空管の概略 図.

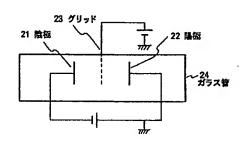
【符号の説明】

- 11 ソース電極
- 20 12 ドレイン電極
 - 13 絶縁体
 - カーボンナノチューブゲート電極 14
 - 21 陰極
 - 2.2 鴎極
 - グリッド 23
 - 24 ガラス管

【図1】



[図2]



English of Ref.3

Open-Laid Publication Number: 07-122198

Date of publication of application: 12.May.1995

Application number: 05-266644

Date of filing: 15.Oct.1993

Applicant: Nippon Electric Corporation (NEC)

Inventor: Mutsuo HIDAKA, Junichi SONE, Kazuo NAKAMURA

Representative: Patent Attorney Naoki KYOMOTO

Title of the Invention: CARBON NANOTUBE TRANSISTOR

[ABSTRACT]

[Purpose] To provide an extremely small-sized transistor which operates at low voltage.

[Constitution] A source electrode 11 and a drain electrode 12 are provided on both ends of a carbon nanotube electrode 14 through insulators 13. The nanotube is cylindrical, and the inner part is generally vacuum. Thus, when a voltage is applied between said source and drain electrodes, electrons are emitted from said source electrode to said drain electrode to form a drain current.

When a gate voltage is applied to said nanotube 14, the number of electrons reaching the drain can be controlled, and the nanotube is operated as a transistor.

[CLAIMS]

[Claim 1] A carbon nanotube transistor characterized in that a source electrode and a drain electrode are provided on both ends of a carbon nanotube used as a gate electrode through an insulator, a voltage is applied between said source electrode and said drain electrode to emit electrons toward said drain electrode from said source electrode, and the number of said electrons reaching said drain is controlled by a gate voltage applied to said carbon nanotube.

[Claim 2] The carbon nanotube transistor according to claim 1, wherein said insulator is not formed at a portion of said source electrode from where said electrons are emitted.

DETAILED DESCRIPTION

[0001]

[Industrial Application] This invention relates to a transistor used in an electronic circuit etc.

[0002]

[Prior Art] Fig. 2 is a schematic diagram showing a conventional 3 pole vacuum tube. In the 3 pole vacuum tube, electrons are emitted from cathode 21 by applying a voltage between said cathode 21 and anode 22, and said electrons are received by anode 22. If positive voltage is applied to a grid 23 at the time, the number of electrons which reach to said anode 22 decreases, because electrons are captured by said grid. Thus, there is constructed a transistor which control a current between the cathode 21 and the anode 22 by controlling the grid voltage. Moreover, this transistor is sealed in a glass tube 24 to keep running path of electrons in vacuum.

[0003]

[Problems to be Solved by the Invention] The 3 pole vacuum tube described in the Prior Art has a defect that the size is large in comparison with the semiconductor transistor. By this effect, there are arisen some inconveniences that the running time of electrons from cathode 21 to anode 22 is long and the high applied voltage is required, and as a result, it has slow response with high power consumption. Moreover, it was unsuitable for integration.

[0004]

This invention aims at providing a super micro transistor with super-high performance by using of a carbon nanotube to exceed a performance of the semiconductor transistor and to overcome the defect of conventional 3 pole vacuum tube.

[0005]

[The means for solving invention] The present invention is a carbon nanotube transistor characterized in that a source electrode and a drain electrode are provided on both ends of a carbon nanotube used as a gate electrode through an insulator, a voltage is applied between said source electrode and said drain electrode to emit electrons toward said drain electrode from said source electrode, and the number of said electrons reaching said drain is controlled by a gate voltage applied to said carbon nanotube. It is preferable that said insulator is not formed at a portion of said source electrode from where electrons are emitted so that electrons can be emitted with ease.

[0006]

[Function] A carbon nanotube is a microscopic capillary with cylindrical shape of graphite of nano meter size as described in "Solid State Physics" in Volume 27, No, 6, page 441. (1992), and it is a conductor with properties of semiconductor or metal. The diameter of the carbon nanotube (abbreviated as

herein in after nanotube) is very small as 2 to 50 nm. In addition, since the cylinder wall is made from carbonaceous six membered ring, and then gas such as oxygen and nitrogen etc. cannot transmit it. Therefore, if the inside of nanotube is vacuum at the time of manufacturing, the vacuum will not be broken ever after.

[0007]

If a vacuum-tube type transister is constructed by use of the inside of this nanotube as a path of electrons and positive voltage is applied to said nanotube, the electrons can be drawn in a nanotube cylinder wall and current can be modulated. This vacuum-tube type nanotube transistor can modulate the current by applying very low voltage because the size is very small as reflecting the size of nanotube. Moreover, electronic mileage can be shortened and ultra high speed transistor of very small size with small consumption can be realized.

[0008]

[Embodiment] Fig. 1 is a explanatory diagram showing the embodiment of this invention. In the following, the embodiment of the present invention is explained by using of Fig. 1.

[0009] The source electrode 11 made from copper and the drain electrode 12 similarly made from copper are connected to the nanotube 14 through the insulator 13 made from aluminum oxide, respectively. Said nanotube works as

the gate electrode 14. The voltages are independently applied for said gate electrode of nanotube 14 and between said source electrode 11 and drain electrode 12, respectively. It is completely insulated between nanotube gate electrode 14 and source electrode 11, and also insulated between nanotube and drain electrode 12 by insulator 13. The size of said nanotube gate electrode 14 is 30 nm in diameter and 100 nm in length. The thickness of the insulator 13 is 10 nm.

[0010] Since the cylindrical wall of the nanotube gate electrode 14 is made of carbonaceous six-member rings, gas such as oxygen and nitrogen etc. cannot penetrate. Therefore, if the inside of nanotube is vacuum at the time of manufacturing, the vacuum is not be broken after that. (Nanotubes are usually manufactured by the arc discharge in vacuum using carbon electrode.) Operation of the transistor of Fig. 1 is performed as follows. First, the electrons are emitted from the source electrode surface by applying voltage between source electrode 11 and drain electrode 12, and then the electrons reach the drain electrode 12 by drawing of electric field. If positive voltage is applied to the nanotube gate electrode 14, the orbit of electrons emitted from said source electrode 11 is bent, and some electrons flow to the direction of nanotube gate electrode 14. Therefore, the transistor action which modulates the current between source electrode and drain electrode 12 can be obtained by applying the voltage to nanotube gate electrode 14.

[0011] Although, the electric field intensity of a 10⁷ V/cm is required to obtain the field electron emission generally, the working by low voltage in mV order is possible because the distance between source electrode 11 and drain electrode 12 is so short as 120 nm, the tip ends of source electrode 11 and drain electrode 12 are about 30 nm and the value is remarkably small that the electric

field intensity is very strong. Moreover, since the ratio of gate voltage and source drain voltage is proportional to the ratio of radius between the nanotube gate electrode 14 and the source drain electrodes 11, 12 (the ratio of this embodiment is 1:8), the gate voltage can be arranged to be considerably lower than the source drain voltage, and then high gain can be obtained.

[0012] As described above, according to the present invention, the transistor which has high gain with low operating voltage can be obtained. Transistor with low voltage operation can switch in short time and power consumption is small. Furthermore, by reflecting the size of nanotube, the super-micro transistor can be constituted.

[0013] Here, the manufacturing method of this transistor is explained. First, nanotubes are accumulated on an insulating substrate by arc discharge etc. and then nanotubes are transferred to another chamber with keeping vacuum. Next, an aluminum thin film of several nm in thickness is deposited by vacuum deposition method. And then, it is transferred to another chamber, and aluminum oxide is formed by oxidization in oxide plasma. After transferring it to another chamber again, said substrate is included greatly and anisotropic etching with an argon is performed, so that aluminum oxide at both ends of the nanotube are removed and both ends of the nanotube are opened. After that, thin copper film is formed. The thin copper film pattern can be formed by the following steps; streaming gas containing copper as constituent element (organometallic compound etc.) on the substrate, irradiating electron beam squeezed very thinly at only both ends of the nanotube which become source electrode and drain electrode to decomposed said gas. In addition, in order to

form an electrode pattern, there is the following method instead of the electron

beam irradiation; aligning a needle for STM (Scanning Tunneling Microscope) at the predetermined position where the electrode must be formed, streaming said gas, and floaing current between said substrate and said needle to decompose the gas.

[0014]

[Effect of the Invention] As described above, according to the present invention, the super-micro transistor which can be operated with low voltage by using of nanotube can be provided. Said transistor is the very excellent transistor having high switching speed and low power consumption etc.

[Description of Drawings]

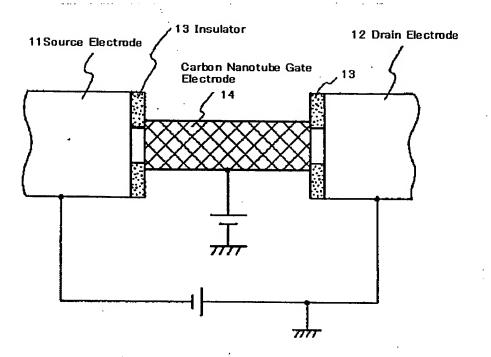
[Fig. 1] The schematic diagram to explain the embodiment of the present invention of transistor using a carbon nanotube.

[Fig. 2] The schematic diagram to explain the conventional 3 pole vacuum tube.

[Description of Notations]

- 11 Source Electrode
- 12 Drain Electrode
- 13 Insulator
- 14 Carbon Nanotube Gate electrode
- 21 Cathode
- 22 Anode
- 23 Grid
- 24 Glass Tube

[Fig.1]



[Fig.2]

